

# Xper-WLI

## (白光干涉仪)

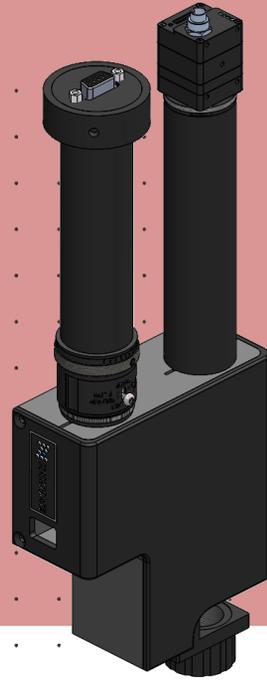
### by NANOBASE

纳米尺度的厚度和轮廓检测

WLI和PSI模式两种模式

工业应用：样品和轮廓检测

样品类型：半导体晶圆，纳米器件，生物材料，MEMS:微电子机械系统，LED发光二极管



## 规格

测量原理  
白光干涉原理

用途：  
表面三维剖面测量，表面粗糙度测量

Z轴分辨率  
1.75 nm

CCD分辨率  
2464 x 2056 pixels

扫描范围  
30 $\mu$ m

物镜倍率  
10x, 20x, 50x, 100x

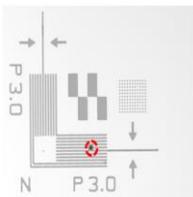
光源  
LED lamp

PSI 滤光片选项  
532nm, 633nm (Visible range : 400~750nm)

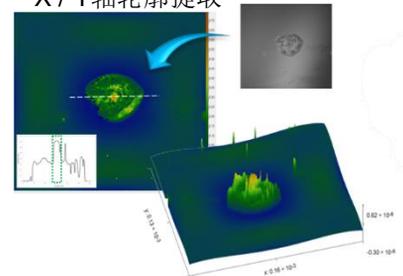
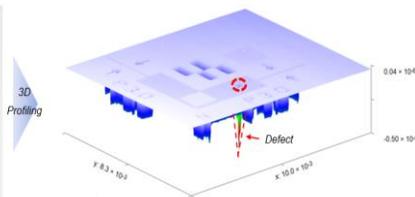
电脑配置  
- CPU : Octa Core 3.0 GHz  
- RAM : 16 GB  
- Storage : SSD 128 GB  
- OS : Windows 10

软件  
自动实验条件设置  
后期处理：平滑处理/ z轴控制因子设置  
/偏移控制  
X / Y轴轮廓提取

## 案例



半导体器件



牙齿细胞成像